

## КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

**УПРУГИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В Si  
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ПАССИВНЫМИ ПРИМЕСЯМИ**

Мизрухин Л. В., Хируненко Л. И., Шаховцов В. И.,  
Шинкаренко В. К., Яшник В. И.

Существует широкий класс точечных дефектов — изовалентных примесных атомов (ИВП), являющихся электрически пассивными (ЭП) центрами в ковалентных кристаллах (например, атомы C, Sn, Ge в Si, Si в Ge). Однако наряду с точечными ЭП дефектами имеются ЭП центры с существенно большим линейным размером по сравнению с размером атомов. Так, известно, что введение при выращивании тигельного кремния редкоземельных элементов (РЗЭ), в частности атомов Gd, приводит к появлению ЭП кластеров (скоплений) атомов Gd с большим разбросом по размерам (от  $10^2$  Å до 10 мкм).

ЭП дефекты при определенных концентрациях могут заметно влиять на некоторые физические свойства кристаллов кремния. В качестве примера можно привести экспериментальные данные по сильному неоднородному уширению полос ИК поглощения водородоподобных центров (ВПЦ) [1] и кислорода ( $\text{Si}_2\text{O}$ ) [2] в  $\text{Si}\langle\text{Ge}\rangle$ , линий ЭПР тензозондов в Si с ИВП [3], полос экситонной люминесценции в сплавах  $\text{Si}\langle\text{Ge}\rangle$  [4], существенному влиянию ЭП дефектов на кинетику накопления радиационных дефектов (центры непрямой аннигиляции [5], стоки [6]). Во всех перечисленных случаях основной причиной описанных эффектов является, как считает большинство авторов этих работ, наличие внутренних хаотических деформационных полей, создаваемых ЭП примесями. В случае точечных изовалентных примесей упругие поля возникают вследствие несовпадения ковалентных радиусов атомов матрицы и примеси. Для ЭП примесей типа кластеров РЗЭ деформационные поля возникают на границе матрица — кластер.

Одним из наиболее ярко выраженных эффектов, связанных с ЭП примесями, является неоднородное уширение полос ИК поглощения (ВПЦ) в Si. Ранее нами этот эффект изучался для ИВП Ge в Si [1]. В настоящей работе исследовалось влияние примесей Sn, Gd в Si и Si в Ge на полуширину и форму полос поглощения ВПЦ.

Спектры ИК поглощения исследовались на инфракрасном фурье-спектрометре IFS-113V в интервале температур 2–77 K с разрешением не хуже 0.1 см<sup>-1</sup>. Кристаллы выращивались методом Чохральского. Концентрация электрически активных примесей (P и Sb) определялась из холловских измерений и составляла  $(1 \div 2) \cdot 10^{14}$  для P и  $4 \cdot 10^{14}$  см<sup>-3</sup> для Sb. Исследуемые кристаллы подбирались близкими по содержанию основных технологических примесей — кислорода [ $N_{\text{O}} = (4 \div 7) \cdot 10^{17}$ ] и углерода [ $N_{\text{C}} = (2 \div 5) \cdot 10^{16}$  см<sup>-3</sup>]. Концентрация Si в германии измерялась рентгеноспектральным анализатором SP-733 с абсолютной погрешностью не более  $1 \cdot 10^{18}$  см<sup>-3</sup> и составляла  $1.4 \cdot 10^{19}$  см<sup>-3</sup>. Содержание Sn и Gd определялось нейтронно-активационным анализом и изменялось в пределах  $2 \cdot 10^{18} \div 1.7 \cdot 10^{19}$  для Sn и  $8 \cdot 10^{14} \div 2 \cdot 10^{18}$  см<sup>-3</sup> для Gd.

На рис. 1, a представлены спектры поглощения P в Si с примесью Sn. Видно, что с ростом концентрации атомов Sn до  $1 \cdot 10^{19}$  см<sup>-3</sup> резонансные линии существенно уширяются. Проведенное исследование температурной зависимости

полуширин полос поглощения показало, что уширение является неоднородным, поскольку в диапазоне температур 3–45 К полуширина полос практически не изменяется.

Аналогичные результаты получены при изучении спектров поглощения Sb в твердом растворе Ge<sub>x</sub>Si<sub>1-x</sub> (рис. 1, б). В отличие от P в Si для Sb в Ge спектр поглощения более сложен и состоит из накладывающихся друг на друга линий, что связано с небольшими расстояниями между подуровнями основного и возбужденных состояний мелкого центра Sb ( $E_1 = 0.0098 \text{ эВ}$ ). Как видно из рис. 1, б, легирование кремнием приводит к уширению линий поглощения Sb и к еще большему перекрытию линий.

Аналогичная картина наблюдается для P в Si с примесью Gd. Однако в отличие от ИВП неоднородное уширение наблюдается начиная с концентраций

$N_{\text{Gd}} \geq 10^{15} \text{ см}^{-3}$ . По-видимому, это может свидетельствовать о коррелированном распределении P и кластеров Gd.

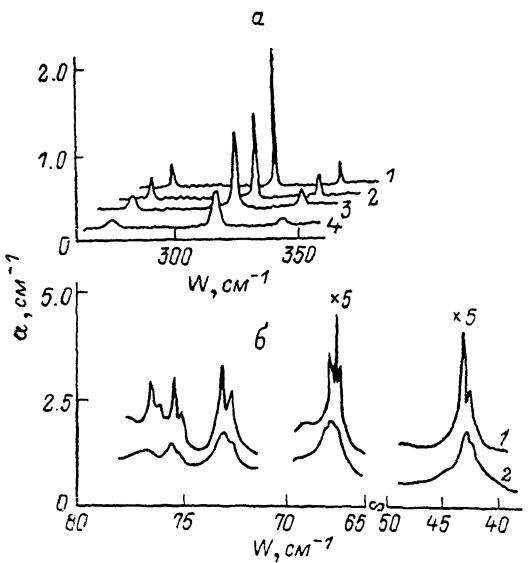


Рис. 1. Спектр поглощения фосфора в кристаллах Si<Sn> и Sb в Ge<Si> при  $T \leq 4 \text{ К}$ .  
а: 1 — Si(P), 2 — Si(Sn, P) ( $N_{\text{Sn}} = 4.5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ ),  
3 — Si(Sn, P) ( $N_{\text{Sn}} = 1 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ ), 4 — Si(Sn, P)  
( $N_{\text{Sn}} = 1.7 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ ). б: 1 — Ge(Sb), 2 — Ge(Si, Sb)  
( $N_{\text{Si}} = 1.4 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ ).

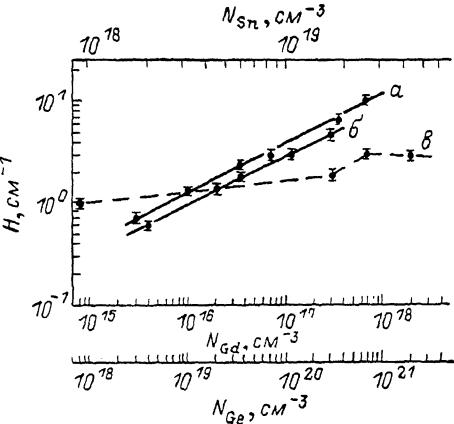


Рис. 2. Зависимость полуширины линии поглощения 1s-2p фосфора от концентрации ЭП примесей.  
а — Si<Ge, P>, б — Si<Sn, P>, в — Si<Gd, P>.

Отметим следующую закономерность, наблюдавшуюся в наших экспериментах: увеличение ковалентного радиуса ИВП при равных концентрациях приводит к росту величины неоднородного уширения ВПЦ в Si. Это позволяет подтвердить сделанный ранее вывод [1] о том, что основной причиной неоднородного уширения являются хаотические деформационные поля, возникающие из-за несоответствия ковалентных радиусов матрицы и ИВП. В литературе [4] высказывалась другая точка зрения на причину уширения резонансных полос ИК поглощения при наличии в кристаллах Si ИВП. Предполагалось, что при увеличении концентрации ИВП уменьшается время жизни экситонов, что через соотношение неопределенности Гейзенберга приводит к увеличению неопределенности в ширине линий. Однако наш эксперимент не подтверждает эту точку зрения, поскольку при одной и той же концентрации ИВП величина неоднородного уширения при переходе к ИВП с большим ковалентным радиусом возрастает. Об этом же свидетельствует и независимость спектров от температуры в интервале 3–45 К. Дополнительным подтверждением существования хаотических деформационных полей является наличие сильно неоднородного уширения колебательного перехода (колебание  $v_2$ ) в квазимолекуле Si<sub>2</sub>O [2].

В предыдущей работе [1] нами установлено, что форма полос поглощения в Si с ИВП близка к Гауссовой, а полуширина резонансных линий

$$H \sim \sqrt{N_{\text{ИВП}} |A|},$$

(1)

где  $N_{\text{ИВП}}$  — концентрация ИВП, а  $A$  — деформационный заряд ИВП.

На рис. 2 в двойных логарифмических координатах представлены экспериментальные зависимости  $H$  для линий  $1s-2p$  фосфора от  $N_{\text{ИВП}}$ . Видно, что экспериментальные точки для ИВП хорошо ложатся на теоретические прямые, соответствующие наклону  $1/2$ , как это и следует из формулы (1). Сдвиг прямой по вертикальной оси обусловлен различными значениями деформационных зарядов и разбросом в ширине линий для кристаллов с различным исходным примесным составом. Сложность спектра поглощения Sb в Ge затрудняет проведение аппроксимации полуширины линий поглощения и построения зависимости  $H$  от  $N_{\text{Si}}$ .

Некоторой особенностью обладает зависимость  $H$  от  $N_{\text{Gd}}$ . Во-первых, наклон прямой заметно меньше  $1/2$ , а, во-вторых, при концентрации  $N_{\text{Gd}} \approx 3 \times 10^{17} \text{ см}^{-3}$  возникает скачок с последующим выходом на полочку при  $N_{\text{Gd}} \geq 7 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ . По всей видимости, скачок является следствием изменения характера распределения Gd в Si. Что же касается линейного участка в диапазоне концентраций  $N_{\text{Gd}} = 8 \cdot 10^{14} - 3 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ , то здесь причиной отклонения от теоретической зависимости (1) является то, что в теории центрами, создающими упругие поля, являются атомы ИВП, а в данном случае такими центрами являются кластеры Gd.

Таким образом, экспериментально установлено, что имеется однозначная корреляция между полушириной неоднородно уширенных резонансных линий ВПЦ и ковалентным радиусом ИВП: увеличение ковалентного радиуса при фиксированной концентрации ИВП соответствует росту полуширины линий в согласии с теоретической зависимостью (1). Можно считать, по-видимому, что основной причиной неоднородного уширения линий поглощения ВПЦ в ковалентных кристаллах — кремний и германий с ЭП примесями является наличие хаотических деформационных полей, возникающих в случае ИВП за счет несоответствия ковалентных радиусов матрицы и ИВП, а в случае РЗЭ — упругих полей, создаваемых кластерами атомов примеси.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Мизрухин Л. В., Мильвидский М. Г., Хируненко Л. И., Шаховцов В. И., Шинкаренко В. К., Горбачева Н. И. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 9. С. 1647—1653.
- [2] Хируненко Л. И., Шаховцов В. И., Шинкаренко В. К. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 12. С. 2222—2225.
- [3] Кустов В. Е., Мильвидский М. Г., Семенов Ю. Г., Туровский Б. М., Шаховцов В. И., Шиндиц В. Л. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 2. С. 270—274.
- [4] Лопатин А. Б., Покровский Я. Е. // ФТП. 1986. Т. 28. В. 8. С. 2373—2378.
- [5] Хируненко Л. И., Шаховцов В. И., Шинкаренко В. К., Шпинар Л. И., Яковец И. И. // ФТП. 1987. Т. 21. В. 3. С. 563—565.
- [6] Нейман В. Б., Соснин М. Г., Туровский Б. М., Шаховцов В. И., Шиндиц В. Л. // ФТП. 1982. Т. 16. В. 5. С. 901—903.

Институт физики АН УССР  
Киев

Получено 29.08.1988  
Принято к печати 19.10.1988

ФТП, том 23, вып. 4, 1989

#### О СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В СТЕКЛООБРАЗНОМ AsGeSe, ОБЛУЧЕННОМ БОЛЬШИМИ ДОЗАМИ НЕЙТРОНОВ

Конорова Л. Ф., Жданович Н. С., Дирик В. А., Прудников И. М.

Проблема структурных превращений в халькогенидных стеклообразных полупроводниках (ХСП), индуцированных воздействием проникающего излучения, вызывает большой интерес исследователей в связи с необходимостью